

장비사용료 요율표(나노융합본부)

순번	장 비 명	장비사용료(원/시간)		내구 연한	비 고
		장비지원	직접지원		
1	대형 평판형 증착장비	130,000	170,000	12년	※ 전기료 실비 청구 200원/kW ※ 타킷 사용료 포함
2	자외선 노광 공정	150,000	200,000	9년	※ 용액 및 코팅물질 별도 청구 또는 지참
	위상전이 자외선 노광 시스템				
	대형스프레이 코팅 시스템 대면적 원통/평판 현상 시스템				
3	대면적 원통 박막 코팅 장비	50,000	80,000	10년	※ 용액 및 코팅물질 별도 청구 또는 지참
4	평판금형 래핑장비	27,000	56,000	12년	※ 금형 거치 가능 사전 테스트 비용(로딩, 가 조건 설정 등): 300,000원
5	평판롤 열판/건조로	25,000	30,000	12년	
6	감광제 두께측정 시스템	25,000	40,000	11년	
7	평판형 대면적 3차원 현미경	30,000	45,000	10년	
8	이온빔 가공 장비	110,000	150,000	10년	※ 전처리비(백금 증착) 10,000원/개 ※ FIB 이미지 요금 추가 5,000원/매 ※ SEM 기능만 이용 시: 직접지원 60,000원/hr, 장비지원 30,000원 /hr, 이미지 5,000원/매 ※ EDS 이용 시: 30,000원/hr, 기본 5개 포인트 측정 실시, 1개 포인트 추가시 5,000원
9	곡면나노임프린팅장비	62,000	90,000	12년	※ 필름 및 코팅물질 별도 청구 또는 지참
10	다이아몬드터닝머신	91,000	108,000	11년	※ 금형 및 다이아몬드 커터 별도 청구 또는 지참
11	나노패턴 대면적 레이저 시스템	46,000	64,000	11년	※ 용액 및 코팅물질 별도 청구 또는 지참 ※ 글라스 및 실리콘 웨이퍼 청구 또는 지참
12	광특성분석장비	4,000 (원/회)	5,000 (원/회)	12년	※ 기본 6회 측정 ※ 기본 1시간으로 산정하되, 회당 측정 시 소요시간 10분
13	정밀 레이저 커팅 장비	30,000	51,000	11년	
14	알파스텝 프로파일러 장비	3,000 (원/회)	5,000 (원/회)	11년	※ 기본 6회 측정 ※ 기본 1시간으로 산정하되, 회당 측정 시 소요시간 10분
15	스크린 프린팅 장비	19,000	48,000	11년	※ 코팅물질 별도 청구 또는 지참
16	산소투과도 시험기	4,500	29,000	11년	
17	수분투과도 시험기	4,000	27,000	10년	
18	라만분석장비	13,500	39,000	11년	

순번	장 비 명	장비사용료(원/시간)		내구 연한	비 고
		장비지원	직접지원		
19	DFR 라미네이터 공정 시스템 장비	40,500	79,000	10년	※ 용액 및 코팅물질 별도 청구 또는 지참 ※ 글라스 및 실리콘 웨이퍼 청구 또는 지참
20	복합환경 신뢰성 챔버	16,000	44,000	11년	
21	대면적 스피너	20,000	49,000	11년	※ 용액 및 코팅물질 별도 청구 또는 지참 ※ 글라스 및 실리콘 웨이퍼 청구 또는 지참
22	대형 나노금형 리페어 장비	15,000	44,000	10년	
23	비표면적 분석장비	12,000	41,000	10년	
24	원자현미경	24,000	53,000	9년	
25	다목적엑스선회절분석기	47,000	76,000	10년	
26	입도/분산측정기	8,000	37,000	11년	
27	밀도분석시스템	12,000	41,000	10년	
28	나노구조체 회절특성 분석용 UV 레이저 시스템	4,000	33,000	9년	

※ 시험성적서 발행비 10,000원 / 성적서 부분 10,000원
※ 대형 평판형 증착장비 사용 시 전기세 실비 청구 - 200원/kW
※ 일부 장비 고압가스 및 재료비 미지참 시 별도 실비 청구(산소, 아르곤, 질소, 감광제, 현상액, 필름, 타킷 동작기계용 공구 등)
※ 클린룸 장비 사용료: 21,000원/회